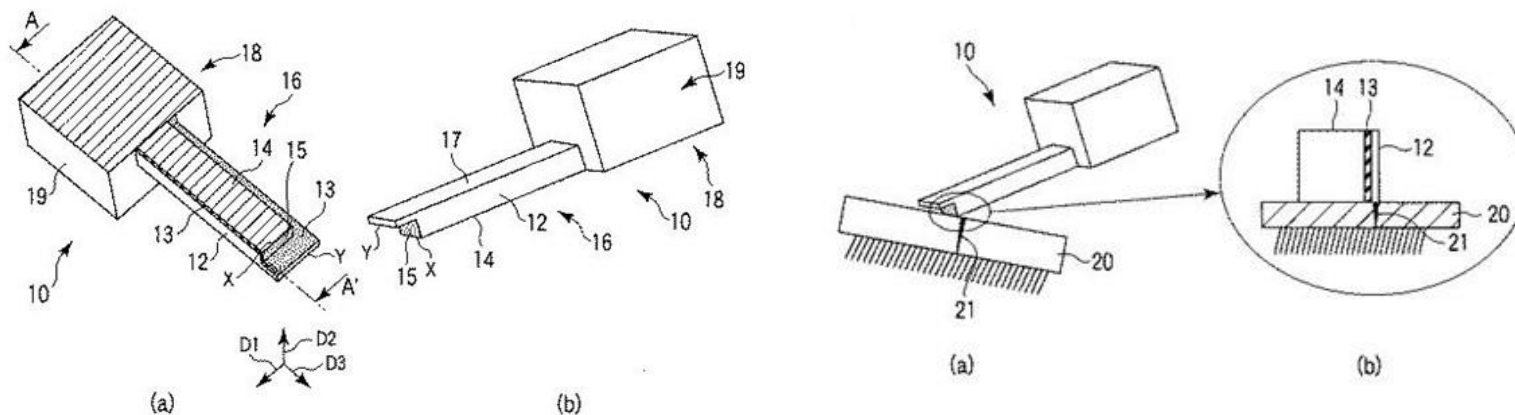


公開番号／特許登録番号	特許5044685
発明の名称	マイクロプローブ、記録装置、及びマイクロプローブの製造方法
出願人または特許権者	株式会社 東芝 国立大学法人 東京大学

発明の内容 (概要)

【課題】 走査型プローブ顕微鏡 (SPM) の原理を利用したプローブ型MEMSメモリで、プローブ先端の記録／再生用電極と記録媒体との間の様々な物理的相互作用を利用して情報の書き込み、読み出し (再生)、及び消去を行う記録装置で、プローブ先端部を安価かつ容易に製造できるマイクロプローブ。

【解決手段】 プローブ先端に優れた耐摩耗特性を有し、また、安価かつ容易に製造することができる。また、本実施形態のマイクロプローブは、プローブ先端と記録媒体の接触状態を良好なものとし、これにより有効寿命の向上及び記録特性の安定化を図っている。



(a) ボトム方向からみたマイクロプローブの斜視図
(b) トップ方向からみたマイクロプローブの斜視図

(a) マイクロプローブ10と記録媒体20とが接触した状態。
(b) マイクロプローブ10と記録媒体20とが接触している部分を拡大。

- | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 10 : マイクロプローブ | 12 : 電極層 | 13 : 絶縁層 | 14 : 保護台 | 15 : 段差 | 16...レバー部 |
| 17 : レバー部電極 | 18 : 支持土台部 | 19 : 支持土台部電極 | 20 : 記録媒体 | 21 : 記録ビット | |